マルチスクリーンを用いた高ダイナミックレンジ 2 次元ビームプロファイルモニター

A TWO-DIMENSIONAL BEAM PROFILE MONITOR HAVING HIGH DYNAMIC RANGE BY USING MULTI-SCREEN

手島昌巳^{A)},橋本義徳^{#,A)},三橋利行^{B)},大津 聡^{C)},外山 毅^{A)}

Masaki Tejima ^{A)}, Yoshinori Hashimoto ^{#, A)}, Toshiyuki Mitsuhasi ^{B)}, Satoru Otsu ^{C)}, Takeshi Toyama ^{A)} ^{A)} KEK/J-PARC, ^{B)} KEK, ^{C)} Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd.

Abstract

A two-dimensional beam profile monitor with a high dynamic range for 3-50 BT at J-PARC has been developed. For measuring the beam core and the halo alternatively, the monitor has three kinds of screens. The first one is titanium foil OTR screen (thickness of 10 μ m) to measure a beam core, the second one is aluminum foil OTR screen (thickness of 100 μ m) having a hole (50 mm diameter) in the center, and the last one is a pair of alumina fluorescent screen with a separation of 80 mm in horizontal to observe the beam halo in surroundings. We designed an optical system based on the Offner optics for the observation of fluorescence and OTR lights. This optical system has an entrance aperture of 300 mm and it can cover the large opening angle (+/- 13.5 degree) of the OTR from 3GeV protons. A CID camera with an image intensifier (I.I.) was use to observe the profile. We have succeeded to observe a profile of beam halo to 10^{-6} order to the peak of beam core by using proton beams of 3GeV, 9.6 x 10^{12} protons/2bunch by this multi-screen scheme.

1. はじめに

ハロー領域までを含めたビームプロファイルモニ ターは、特に大強度加速器の運転においては、ビー ムコリメーションを診断し最適化を図ること、また ロスを制御するなどの重要な診断の役割を受け持つ. そして2次元での測定ではさらに高度な情報を得る ことができる.

我々は, J-PARC の MR への入射路である 3-50 BT のビーム診断装置として、まず OTR 光を用いた ビームプロファイルモニターを開発した[1,2,3]. こ のモニターでは、1e10 p/bunch 以上の強度のビーム からの光を検出できることを確認した. ビームコア 部の2次元プロファイルは, 5el1 p/bunch 以上で有 意に診断できた.3GeV のビームを感度を上げて OTR 光で計測することはそれほど簡単ではない. ビームエネルギーが 3GeV であるため, ビームのγ に依存した角度広がりが±13.5°と大きいこと、さ らに σ が 15mm 程度のサイズの大きなビームである ことなどのハンディキャップがあるためである. れらを克服するために、受光口径 300mm の大きな 凹面鏡を持つ Offner リレー光学系を採用して, OTR 光の収率を上げる工夫を行ったことが、この成 功の鍵となったと考えている.

現在, さらなる高感度化を目指しての開発を進めている. 特にビーム周辺のハロー領域の計測がそのポイントである. 検出器を高感度化する方法や, さらなる OTR 光の収率を高める方法などの具体化も進めている. これらは OTR 光だけを用いて高感度化を図る方法である. 別の観点からのアプローチとして, ビーム周辺のハロー領域に限定して, OTR 光

を使わずに、より発光量の高いスクリーンを用いる 方法を今回採用した.特に Al₂O₃ + Cr (アルミナ) のスクリーンは発光量も高く残光が長い時間に亘っ て続くためにその光量を積分することで収量を増や すことができるアドバンテージを持つ.同じ観点に 立っての次のステップとしては、OTR ターゲットと アルミナスクリーンを一緒にマウントしたターゲッ トを用いて、ビームコアとハローの同時試験を試み る予定であったが、夏前のスタディーでは時間切れ であった.

2. マルチスクリーンと測定光学系



Figure 1: The multi screen. (a) Titanium foil of $10 \ \mu m^t$ (TS). (b) Aluminum foil of $100 \ \mu m^t$ having a hole of 50 mm dia. (50S). (c) Cr doped Al₂O₃ screens of 0.5 mm^t (AS).

マルチスクリーンは, Fig.1 のように円形の3 連で 構成されており, リング内径は 120 mm, スクリー ンのピッチは 150 mm である. これらは一つのフ レームに収められており, 水平方向にステッピング モータにより直線導入され, ビームコアからテール のハロー領域までを切り替えて使用する. また図(b), (c) のスクリーンのエッジをビームに対して任意の

[#] yoshinori.hashimoto@kek.jp

位置にセットすることができる. 図(a)の 10 μ m^t チタ ンフォイルのソリッドスクリーン(TS)の非平坦性は, 22(±7.5) μ m である[4]. 同図(b)の 50 mm 直径の穴 あきターゲット(50S)は、ビーム周辺を OTR 光で計 測し、同図(c)のアルミナスクリーン(京セラ A486: AS)では、蛍光(Fluorescence Light: FL)を用いて、さ らに周辺のハローを高輝度で計測する役割を持つ.

光学系は 3GeV 陽子ビームからの OTR 光を前提 に設計してある. OTR 光は、ビームの速度に関する パラメータ γ に強く依存した特性を持つ. 放出光子 数は、OTR 光の波長領域(ω_1, ω_2)の関数として、次 式で表される[5].

$$N = \frac{2e^2}{\pi \hbar c} \left| \ln(2\gamma) - \frac{1}{2} \right| \ln \frac{\omega_2}{\omega_1} \tag{1}$$

3GeV 陽子で可視域の光の放出光子数は, 2.5×10¹⁰ photons/10¹³ protons となる[1,3]. また OTR 光の 放出角度分布は,光速度比β を用いて次式となる[5].

$$I(\theta) = \frac{1}{\gamma^2} \left| \frac{-\sin(\theta)}{1 - \beta \cos(\theta)} \right|^2$$
(2)

3GeV の場合の放射角分布(Fig.2)は、放射角ピーク が±13.5° となり大きな広がり角を持つ.



Figure 2: Calculated emitted OTR angle distribution $(I(\theta))$ with 3GeV Proton (blue thin solid line). Green point marker means measured exit angle distribution of the diffuser screen. Red dotted curve means their convolved value.

また, OTR 設置位置でのビームサイズは, 15 mm (σ)程度であり, ビームテールのハロー領域は 100mm 近いと予想された.

我々は、このような広がりを持った OTR 光の計測 のために、受光口径 300mm (受光角±15°)の



Figure 3: The OTR chamber containing the Offner optical relay system.

Offner 光学系をもつ装置を製作した(Fig.3, [1,2,3]). Offner 光学系の焦点面には,拡散板スクリーン (Diffuser Screen: DS,厚み 5mm:研磨#300,砂ず りの粒径 100 µm 以下,合成石英)を置き,OTR 光 の指向性を緩和させる.DS での拡散面からの出射 角分布は,波長 650 nm の半導体レーザー光を用い てテストベンチで計測した結果,FWHM は 14°で あった(Fig.2).このDS の出射角分布と OTR の放射 角分布とのたたみ込み積分した結果を Fig.2 にプ ロットした.大気側の計測器(光学系)はDS に焦 点を合わせてこのカーブの角度分布をもつ光を検出 する.

OFFNER 光学系の特性をテストベンチで測定した. 焦点深度は,±10 mm 程度であった.垂直と水平方 向での焦点位置が 3mm 程度異なるアスティグマ ティズムが見られた.10 mm ピッチのグリッドスク リーンを用いた評価(Fig.4)では,水平方向±100 mm, 垂直方向 +30/-60 mm の範囲で良い結像を見た.中 心部では,0.2 mm 程度の空間分解能を持つ.垂直上 方方向(反転)の領域が狭くなるのは,中央の凸面 鏡で視野を削っていることの影響である.



Figure 4: A result of focusing test on the actual Offner optics at a test bench.

3. 測定装置

測定装置は, 集光レンズ, Image Intensifier (I.I.) をリレーレンズ で CID (Charge Injection Device) カ メラに接続する構成である. CID カメラのビデオ出



Figure 5: Detector setups. The path length from the thin foil target to the front of the detection lens was almost 2300 mm.

カ信号は,約 400m 遠隔の電源棟まで,5D サイズ の同軸ケーブルで転送し,10 bit Video ADC でデジ タル化している.測定装置のセットアップを Fig. 5 に示す.DS からレンズフロントまでの距離は 560 mm であり集光レンズの開口角は 2.7°である.この 集光角では,Fig.2 の Convolved カーブを見ても明 らかなように,大きな放射角分布をもつ OTR 光に 対しての収率が悪い.OTR スクリーンで発生した全 光子の 10⁻⁵ 程度の検出率となる.測定装置の主要な スペックは Table 1 にまとめる.

Table 1: Specifications of the detecting devices.

Device	Item	Specification
Focus Lens	Focal Length	17 mm
[YakumoYMV2595N]	F number	0.95
	Image Format	1" (16 mm dia.) 12.8×9.6
	Front Aperture	26.8 mm
Image Intensifier	МСР	Single Stage aperture 18 mm
[HPK V2697U]	Luminous Gain	12000[lm/m ² /lx] at MCP 900V
	Resolution	30 [lp/mm]
	Phosphor Screen	Persistence: ~1ms
Relay Lens	Magnification	0.5
CID Camera	Radiation Tolerance	300kGy
[ThermoFisher8725D]	Image Format	1"
	Sensitivity	0.1 lx

また I.I.のゲインカーブを Fig.6 に示す. I.I. のゲ インを変えて,同じ条件のビームプロファイルを計 測しその光量を 10bit ADC で計測して 2 点の比を求 める方法により,カーブとしてつないだものである. 実際のビーム計測時には,ゲインを変えても計測し たビーム幅が変化しない電圧範囲を求め,その中心 値に MCP 電圧をセットしている.



Figure 6: The gain curve of the image intensifier (Hamamatsu V2697U). Plotted data were measured with light quantity by beam profiles.

4. ビームプロファイルの測定

4.1 OTR 光による大強度ビームの測定

将来のために現在の営業運転時の 3e13/2bunch よ りも高い強度である 4.2e13/2bunch のビームによる 加速器スタディーが行われ, OTR ターゲットでの ビームプロファイルをシングルショットで計測した 結果を Fig.7 に示す.



Figure 7: An one-shot beam profile by OTR light with a two bunches their total intensity was 4.2e13 protons. (a) The image data. (b) Projected data. Each fitted line is Gaussian.

測定時の I.I. の MCP 電圧は 850V であった. 図の ように S/N の良いほぼ Gaussian に近いプロファイ ルが得られた. 大強度ビームではテール部が注目さ れるが,水平(H)では右側テールに小さなコブが見 られ,左側テールでは細くなっているなどのアンバ ランスが見られた.



Figure 8: A superimposed data measured with OTR and fluorescence lights.

4.2 OTR 光と FL 光を用いた高感度測定

ビームコアからハロー領域のビームテイルまでを, やや低めのビーム強度である遅い取出しの営業運転 モードの 9.6e12/2bunch において計測した. 測定に は, Fig.1 の 3 種類のスクリーンを用いた. それぞれ の測定では, I.I.のゲインを光量に応じて最適化して いる. また I.I.ゲート時間を 10 µs にセットし, 2 bunch/shot で, 平均化するために連続する 5 ショッ トを取得した. またデータからビーム不在時のバッ クグラウンドを差引いている.

測定データをスーパーインポーズした図を Fig.8 に示す.中央のビームコアは TS により,そのすぐ の外側の三日月型のテイル部は 50S により,共に OTR 光を測定した.さらに外側の左右それぞれ3つ のプロファイルは, AS からの FL 光によるものであ る.図の下の水平方向に射影したプロファイルは ピーク値でノーマライズしたものである.尚,以下 の解析は,全て水平(H)方向に射影したプロファイ ルを用いて行った.

4.3 OTR 光と FL 光の光量比

これらのプロファイルデータをつないでひとつな がりの空間分布を作成するためには、次が必要であ る.

i) OTR 光と FL 光の収量比

ii) I.I. のゲインカーブ

ii)は, Fig.6 で求まっているので, i)を測定するために, ±25mm にセットした AS からの FL 光を用いたプロファイルと 50S からの OTR 光のプロファイルの比較を行った(Fig.9). この測定時の I.I.の MCP 電圧は, OTR 光計測のとき 1000 V, FL 光測定のとき 500V であった. 図の(c), (d) に赤と青のマークでそれぞれ OTR, FL のプロジェクションを示す. FL/OTR の収量比 を求めるには,まず測定データの面積(カウント) 比を求め,次に MCP ゲインの補正を行う 2 段階の 手順を行った.



Figure 9: Comparison of beam profiles of by OTR light with by fluorescence light. (a) and (b) are profile images, (c) and (d) are their projected profiles. In (c) and (d), green solid lines are both corrected OTR's curve by light quantity ratio of FL/OTR. Both the corrected lines agree with FL curves.

まず,図中の両矢印の領域である[-35, -26.5] mm 及び[26.5, 35] mmの範囲で,カーブを積分して,FL とOTRの面積比を求めた.ビーム左側の(c)のプロ ファイルでの比の値は 1.908 であり,右側の(d)のプ ロファイルでの比の値は,1.773 であった.これら から左右の比の平均として,面積比 FL/OTR=1.84 (±3.7%)となった.(c),(d)で,元のOTRのデータを 1.84 倍したものを,それぞれに緑のマークでプロッ トした.これと FL(青)は,スロープの部分でよく一 致していることを確認した.

次に、OTR データ取得時の MCP 電圧 1000V と FL の 500V での収量比を補正するために、Fig.6 の カーブから、ゲイン比 MCP1000V/MCP500V を求め ると 5.0e4/7.0e1=714.3 である、したがって、面積比 FL/OTR にこのゲイン比を乗じて、収量比 FL/OTR=1.84×714.3=1314.6 となった.

ただし、この値は次の2つの条件を考慮すべきも のである。一つは、測定時の I.I. のゲートが 10 µs であり、これが FL 光に積分効果をもたらすことで ある。発光時間が正味の 2 バンチのビーム時間幅 (200ns×2 bunch)だけの OTR 光に対し、FL 光の残光 時間は長く,数100ms以上であるために,ゲート時間全ての発光であったことである.このため正味の積分時間比は,FL/OTR=10µs/400ns~25程度と見積もることができる.この値は今後,II.ゲート時間を変えて正確に測定する予定である.二つ目は,光の放出角分布が,OTR光とFL光では異なることである.OTR光がFig.2に示す放出角分布を持つのに比べ,FL光は等方に分布している.このことはDSでの拡散を含めたOffner光学系と2次光学系を合わせた全体の透過光収率に差が生じることになる.これらの定量的な評価は計算も含めて今後の課題である.

4.4 OTR 光と FL 光を用いた高感度測定の解析

さて,上記のようにして実測の光量値で補正する ことにより FL 光相当の OTR 光のプロファイルを求 めることができた.同じ方法により,残りのデータ である TS からの OTR 光と FL 光の測定データを全 て FL 光相当で,かつ同じ I.I. ゲイン相当の値に補 正した.それら全ての補正データをプロットしたも のを Fig. 10 に示す.





全体のデータがほぼ素直な形でつながり, ピーク に対して 10⁶ 以下までのデータを得たことがわかっ た. 黄色の実線は, ビームコアの計測の TS からの OTR 光のデータだけを使った Gaussian フィット の カーブであり, その σ は 10.3 mm であった. また ビーム領域は 100mm 以上にまで及んでいることが わかる. さらに、その形状に注目すると、図の A, A' の領域は、FL 光を±35 mm の位置にエッジをセッ トして計測したデータであるが、Gaussian カーブか ら内側に寄っている. このことは計測地点の 122 m 上流に位置するビームコリメータでのビームテイル のカットの形状を示している可能性がある. また逆 に、図の B, B'の領域では再び広がっており、ほぼ Gaussian カーブ に乗っているが、これはカットさ れたビームが新たなハローを生成している可能性も ある. 今後、ビームコリメータでのカット位置を変 えて、ビームハローの形状との相関をスタディーす る予定である.

5. まとめと今後の課題

OTR 光と蛍光でのプロファイル測定を組み合わせ ることで、ビームの横方向の空間分布を 6 桁程度の 光強度比で測定した. Cr をドープした Alumina Screen を用いるメリットは、残光時間が長いことで あり、時間積分により大きな光量を得ることができ ることである. 今回の測定に用いた II. ゲート時間 の 10 µs よりもさらに時間を伸ばすことで、現在よ りも下の桁までの測定が可能になると考えている. ビームから見て Alumina Screen を OTR の Solid Screen の直前のハロー領域にセットすることで、 OTR 光と蛍光を同時に計測できるターゲットシステ ムの設計を行っている. これにより、ビームコアか らハローまでをワンショットの計測で行うことがで きると考えている.

今回は、限られたスタディー時間での最初のハ ロー計測のデータとその解析を報告した.今後はシ ステムの特性を含めてさらに高精度な測定装置とし て完成度を高めてゆきたい.

最後に謝辞を記す.本装置の設計,製作,設置に 関して,MR 真空グループの堀洋一郎,魚田雅彦, 嶋本真幸,佐藤吉博の各氏には大変お世話になった. 設計の詳細は,清和製作所の齊藤 斉氏にお世話に なった.また,三菱電気システムサービスの大森雄 基,秋野英之,鶴田秀範の各氏にご尽力いただき緻 密な測定ができた.

参考文献

- M. Tejima, et al., "Development of an OTR Beam Profile Monitor for 3-50 Beam Transport Line in J-PARC", Proc. 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2012, p.590-593.
- [2] S. Otsu, et al., "Target Manufacturing and Evaluation of The Optical System for The J-PARC OTR Beam Profile Monitor", Proc. 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2012, p.577-580.
- [3] M. Tejima, et al., "Development of Offner Relay Optical System for OTR Monitor at 3-50 Beam Transport Line of J-PARC, Proc. IBIC 2012, Tsukuba.
- [4] M. Tejima, et al., "Fabrication Summary on the Equipment of an OTR Beam Profile Monitor for the J-PARC 3-50BT ", these proceedings.
- [5] J. Bosser, J. Mann, G. Ferioli, and L. Wartski, NIM, A238, p45(1985).